

高精度全自動シリコン単結晶 X 線結晶測定装置 DX-7DZ

装置性能

- ▶ 装置自身測定精度は $\pm 30''$ 。スライス機の公差は零の時に、スライス後のウエハー測定角度 100% は $\pm 0.05^\circ$ 以内。
- ▶ 自動に結晶角度を測定、自動に計算角度、角度を設置。
- ▶ 結晶面の角度を測定範囲 (θ 角度) $9^\circ \sim 40^\circ$ 間。
- ▶ インゴット端面に 360° 全方位無死角測定、複検。
- ▶ パルス式ビスコースを採用、排出にかわの中に泡が存在と同時に、インゴットと樹脂ペースプレートは自動合わせる。
- ▶ ネット管理に合わせてデータをアップロード、スキャナーしてシステムにエントリー。



装置の仕様

インゴット直径	6~12 インチ
インゴット最長長さ	450mm
測定結晶面	100,111,110 及び各種測定角度
測定精度	$\pm 30''$
最小示度	1''

注意

本装置は 5-12 インチシリコン単結晶インゴットだけに設計、短いインゴットの測定は出来ません。
DX-7DZ 下記は特別説明部分：本機はインゴット測定と粘着機能を総合して、粘着後に直接ワイヤ放電加工機に置いて、スライスする。インゴット測定機能だけでは出来ません。